

応募条件	募集職名	技術支援員 ・ 1名
	資格等条件	- 理工学系（特に物理学、電気電子工学、または関連分野）の大学卒業、修士修了、または同等の知識・経験を有する方 - クラウドストレージやNAS、SlackやOneNoteなどの情報管理・共有ツールを日常的に使用し、実験データの適切な管理と共有ができる方 - Word、Excel、PowerPoint等を用いた標準的な書類作成能力を有する方 - 協調性があり、学生や教員と円滑にコミュニケーションを取りながら業務を進められる方 - 少なくとも下記の三要件の内一つは満たす方 - 低温環境での物理実験または電気電子工学分野での自作測定系の構築、あるいはそれに類する実験経験がある方 - 希釈冷凍機や超伝導マグネット等の極低温装置の運転・保守経験がある方 - 高圧ガス（特に液体ヘリウムなどの寒剤）の取り扱いや、電気回路工作（半田付け等）実務経験がある方
	業務内容	極低温下での半導体素子（量子ドット等）の測定・解析、およびそれに付随する研究室の実験インフラ整備に関する技術支援業務 - 学生への技術的補助：下記のような実験および測定等を行う学生に対する技術的補助 - 実験用プリント基板の設計及び基板への素子実装（半田付け、ワイヤボンディング等） - 液体ヘリウムベッセルや無冷媒希釈冷凍機を用いた極低温下における半導体素子（量子ドット等）の測定や解析 - ネットワークアナライザやオシロスコープ等、高周波（MHz-GHz帯）測定機器を用いた半導体素子や電気回路の特性評価 - 測定系のノイズ対策 - 極低温装置の保守・管理：複数台の無冷媒希釈冷凍機や無冷媒冷凍機の日常的な保守管理及び障害発生時のトラブルシューティングの対応など - 実験室環境の維持・整備：測定機器の保守・管理、および測定系の作成や補修（SMAコネクタの作製、μ-Dsubコネクタの作製、極低温向け同軸線の加工等）など - OneNoteを用いた実験室関連情報の整理 その他：研究打ち合わせへの参加、必要に応じた資料作成（Word、Excel、PowerPoint等を使用）など、研究室の研究業務を円滑に遂行するために必要な業務 ※業務内容・業務場所、職名については、今後、組織の変更・業務分担の変更に伴い、本学が定める範囲内において変更される可能性があります。 ※詳細は、下記担当までお問い合わせください。 氏名：小寺哲夫 Eメール：kodera.t.ac-sec@ml.m.titech.ac.jp T E L：03-5734-2508
	勤務予定地	東京都目黒区大岡山2-12-1 工学院 小寺研究室
	応募書類	履歴書（使用推奨様式有り・写真貼付・氏名は自署のこと・Eメールアドレス記載） 職務経歴書（※任意・様式自由） *応募書類は返却しません。 *本学での勤務経験がある場合は、所属していた部署名や従事していた研究室名まで詳しくご記入をお願いします。
	応募方法	封筒に「工学院小寺研究室技術支援員②応募書類在中」と朱書し下記提出先宛に郵送、または持参
	応募締切	2026年 8月25日（火） 17時 必着
採用試験	選考方法	第1次：書類選考 第2次：面接試験（Zoom）
	試験日	2026年 9月7日（月） *応募締切後に選考を行い、第1次試験合格者には、前日までに時間・接続情報等を通知します

	内 定 通 知	最終選考の後， 9月14日（月） までに通知
待 遇 及 び 労 働 条 件	雇 用 期 間	2026年 10月1日 ～ 2027年 3月31日 ※更新の可能性有り（最長で 2029 年 3月 31日まで） ※雇用の更新は、更新の必要性、雇用経費及び更新前の勤務実態を総合的に勘案して決定 ※2週間の試用期間有り 業務内容及び労働条件同じ ただし、本学有期雇用職員就業規則第7条,第12条による
	給 与	1. 時間給 1,940円（本学有期雇用職員就業規則第68条による） （通勤手当※本学有期雇用職員就業規則第73条による）
	勤務時間等	1. 1週間の通常勤務時間 週3日21時間 （休憩時間12：15～13：15） 月、水、金： 9:15 ～ 17:15 （7時間） （勤務日・勤務時間は応相談） 2. 超過勤務：無 3. 休日：土曜，日曜，祝日，年末年始（12／29～1／3） 4. 有給休暇及びその他の休暇制度あり
	宿 舎	なし
	社会保険等	厚生年金，共済（短期），雇用保険，労働者災害補償保険
	雇用主	国立大学法人東京科学大学理事長
	その他	敷地内禁煙（ただし，屋外指定箇所に喫煙所設置） ※外為法に基づく特定類型該当性の確認あり
応募書類提出先		〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-2 国立大学法人東京科学大学人事部人事労務課職員第3グループ 後地 T e l : 03-5734-2267, Eメール：hradm.es3@adm.isct.ac.jp